

3. 光触媒と吸着フィルターを使用した高効率な排ガス浄化装置 FUJITSU

日本特許第4,447,213号、第5,126,192号

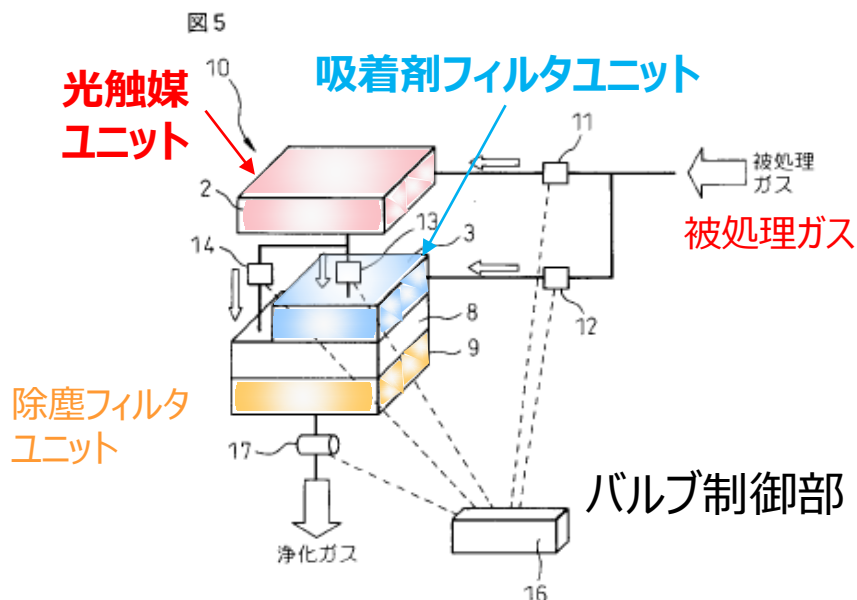
高性能除塵フィルタで除去しにくい流体中の汚染物質(ガス、ミスト)を高効率に分解、吸着することにより除去する環境制御装置

① 低分子量汚染物質⇒ 光触媒

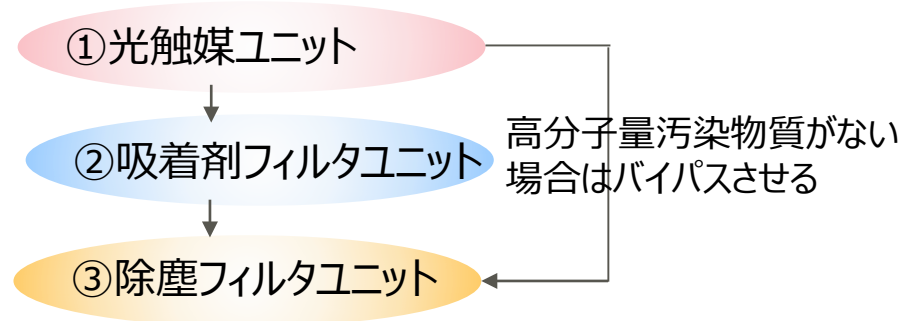
例) 分子量が小さい有機物
(CH_3CO_2 , CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, $\text{CH}_3\text{COC}_2\text{H}_5$)

② 高分子量汚染物質⇒ 吸着剤フィルタ

例) 分子量が大きい有機物
 C_6H_4 , C_6H_{10} , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_3$



流体浄化装置(JP213,JP192)



低分子量汚染物質を光触媒にて先に分解除去することで、
低分子量汚染物質は吸着剤フィルタユニットに至ることがなくなるので、
吸着剤フィルタの寿命を延ばせる

3. 光触媒と吸着フィルターを使用した高効率な排ガス浄化装置 FUJITSU

日本特許第5,532,783号

流体中の汚染物質を高効率に分解することにより除去する装置

■ 光触媒ユニット

- ✓ UV光源が中心軸にある
- ✓ 円筒状光分解部内に塗布された光触媒がUV光源の周囲に配置される
- ✓ 回転しながら除外処理を行う

2 光触媒(TiO₂)が塗布されている

